【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第１区分
【発行日】平成30年6月14日(2018.6.14)

【公表番号】特表2017-514683(P2017-514683A)
【公表日】平成29年6月8日(2017.6.8)
【年通号数】公開・登録公報2017-021
【出願番号】特願2016-566966(P2016-566966)
【国際特許分類】
Ｂ０１Ｊ　29/76　(2006.01)
Ｂ０１Ｄ　53/94　(2006.01)
Ｆ０１Ｎ　3/10　(2006.01)
Ｆ０１Ｎ　3/08　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｂ０１Ｊ　29/76　ＺＡＢＡ
Ｂ０１Ｄ　53/94　２２３
Ｆ０１Ｎ　3/10　Ａ
Ｆ０１Ｎ　3/08　Ｂ

【手続補正書】
【提出日】平成30年4月24日(2018.4.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
（ａ）高多孔度基材のウォール中に白金、パラジウム又はそれらの混合物を含む高多孔度基材、及び（ｂ）高多孔度基材のウォール上のＳＣＲ触媒コーティングを含む触媒物品であって、白金、パラジウム又はそれらの混合物が、金属として又は担持された白金、パラジウム若しくはそれらの混合物として、高多孔度担体のウォール中に存在する触媒物品。
【請求項２】
白金、パラジウム若しくはそれらの混合物、又は担持された白金、パラジウム若しくはそれらの混合物が、高多孔度担体のウォール上のコーティングとしても存在する、請求項１に記載の触媒物品。
【請求項３】
高多孔度基材が約４０％から約８０％の多孔度を有する、請求項１又は２に記載の触媒物品。
【請求項４】
ＳＣＲ触媒が、バナジウム（Ｖ）、モリブデン（Ｍｏ）及びタングステン（Ｗ）、クロム（Ｃｒ）、セリウム（Ｃｅ）、マンガン（Ｍｎ）、鉄（Ｆｅ）、コバルト（Ｃｏ）、ニッケル（Ｎｉ）及び銅（Ｃｕ）及びそれらの混合物からなる群から選択される卑金属を含む、請求項１から３の何れか一項に記載の触媒物品。
【請求項５】
ＳＣＲ触媒がモレキュラーシーブ又は金属交換されたモレキュラーシーブを含む、請求項１から３の何れか一項に記載の触媒物品。
【請求項６】
約０．１重量％から約１重量％の白金、又は約０．１重量％から約２重量％のパラジウ

ムを含む、請求項１から５の何れか一項に記載の触媒物品。
【請求項７】
少なくとも１の卑金属プロモーターを更に含む、請求項１から４及び６の何れか一項に記載の触媒物品。
【請求項８】
少なくとも１の卑金属プロモーターが、ネオジム（Ｎｄ）、バリウム（Ｂａ）、セリウム（Ｃｅ）、ランタン（Ｌａ）、プラセオジム（Ｐｒ）、マグネシウム（Ｍｇ）、カルシウム（Ｃａ）、マンガン（Ｍｎ）、亜鉛（Ｚｎ）、ニオブ（Ｎｂ）、ジルコニウム（Ｚｒ）、モリブデン（Ｍｏ）、スズ（Ｓｎ）、タンタル（Ｔａ）、ストロンチウム（Ｓｒ）及びそれらの酸化物からなる群から選択される、請求項７に記載の触媒物品。
【請求項９】
金属交換されたモレキュラーシーブが、触媒の総重量に対して約０．１から約２０．０重量％の銅を有する銅（Ｃｕ）担持小細孔モレキュラーシーブである、請求項５に記載の触媒物品。
【請求項１０】
ＳＣＲ触媒が、アルミノケイ酸塩モレキュラーシーブ、金属置換されているアルミノケイ酸塩モレキュラーシーブ、アルミノリン酸塩（ＡｌＰＯ）モレキュラーシーブ、金属交換されているアルミノリン酸塩（ＭｅＡｌＰＯ）モレキュラーシーブ、シリコ－アルミノリン酸塩（ＳＡＰＯ）モレキュラーシーブ及び金属置換されているシリコ－アルミノリン酸塩（ＭｅＡＰＳＯ）モレキュラーシーブ及びそれらの混合物からなる群から選択される小細孔モレキュラーシーブを含む、請求項１から３、５、６及び９の何れか一項に記載の触媒物品。
【請求項１１】
ＳＣＲ触媒が、ＡＣＯ、ＡＥＩ、ＡＥＮ、ＡＦＮ、ＡＦＴ、ＡＦＸ、ＡＮＡ、ＡＰＣ、ＡＰＤ、ＡＴＴ、ＣＤＯ、ＣＨＡ、ＤＤＲ、ＤＦＴ、ＥＡＢ、ＥＤＩ、ＥＰＩ、ＥＲＩ、ＧＩＳ、ＧＯＯ、ＩＨＷ、ＩＴＥ、ＩＴＷ、ＬＥＶ、ＫＦＩ、ＭＥＲ、ＭＯＮ、ＮＳＩ、ＯＷＥ、ＰＡＵ、ＰＨＩ、ＲＨＯ、ＲＴＨ、ＳＡＴ、ＳＡＶ、ＳＩＶ、ＴＨＯ、ＴＳＣ、ＵＥＩ、ＵＦＩ、ＶＮＩ、ＹＵＧ及びＺＯＮ及びそれらの混合物及び／又は連晶からなるフレームワークタイプの群から選択される小細孔モレキュラーシーブを含む、請求項１から３、５、６、９及び１０の何れか一項に記載の触媒物品。
【請求項１２】
ＳＣＲ触媒が、ＣＨＡ、ＬＥＶ、ＡＥＩ、ＡＦＸ、ＥＲＩ、ＳＦＷ、ＫＦＩ、ＤＤＲ及びＩＴＥからなるフレームワークタイプの群から選択される小細孔モレキュラーシーブを含む、請求項１から３、５、６及び９から１１の何れか一項に記載の触媒物品。
【請求項１３】
ＳＣＲ触媒が、ＡＥＬ、ＡＦＯ、ＡＨＴ、ＢＯＦ、ＢＯＺ、ＣＧＦ、ＣＧＳ、ＣＨＩ、ＤＡＣ、ＥＵＯ、ＦＥＲ、ＨＥＵ、ＩＭＦ、ＩＴＨ、ＩＴＲ、ＪＲＹ、ＪＳＲ、ＪＳＴ、ＬＡＵ、ＬＯＶ、ＭＥＬ、ＭＦＩ、ＭＦＳ、ＭＲＥ、ＭＴＴ、ＭＶＹ、ＭＷＷ、ＮＡＢ、ＮＡＴ、ＮＥＳ、ＯＢＷ、－ＰＡＲ、ＰＣＲ、ＰＯＮ、ＰＵＮ、ＲＲＯ、ＲＳＮ、ＳＦＦ、ＳＦＧ、ＳＴＦ、ＳＴＩ、ＳＴＴ、ＳＴＷ、－ＳＶＲ、ＳＺＲ、ＴＥＲ、ＴＯＮ、ＴＵＮ、ＵＯＳ、ＶＳＶ、ＷＥＩ及びＷＥＮ及びそれらの混合物及び／又は連晶からなるフレームワークタイプの群から選択される中細孔モレキュラーシーブを含む、請求項１から３、５及び６の何れか一項に記載の触媒物品。
【請求項１４】
ＳＣＲ触媒が、ＭＦＩ、ＦＥＲ及びＳＴＴからなるフレームワークタイプの群から選択される中細孔モレキュラーシーブを含む、請求項１から３、５、６及び１３の何れか一項に記載の触媒物品。
【請求項１５】
ＳＣＲ触媒が、ＡＦＩ、ＡＦＲ、ＡＦＳ、ＡＦＹ、ＡＳＶ、ＡＴＯ、ＡＴＳ、ＢＥＡ、ＢＥＣ、ＢＯＧ、ＢＰＨ、ＢＳＶ、ＣＡＮ、ＣＯＮ、ＣＺＰ、ＤＦＯ、ＥＭＴ、ＥＯＮ、

ＥＺＴ、ＦＡＵ、ＧＭＥ、ＧＯＮ、ＩＦＲ、ＩＳＶ、ＩＴＧ、ＩＷＲ、ＩＷＳ、ＩＷＶ、ＩＷＷ、ＪＳＲ、ＬＴＦ、ＬＴＬ、ＭＡＺ、ＭＥＩ、ＭＯＲ、ＭＯＺ、ＭＳＥ、ＭＴＷ、ＮＰＯ、ＯＦＦ、ＯＫＯ、ＯＳＩ、－ＲＯＮ、ＲＷＹ、ＳＡＦ、ＳＡＯ、ＳＢＥ、ＳＢＳ、ＳＢＴ、ＳＥＷ、ＳＦＥ、ＳＦＯ、ＳＦＳ、ＳＦＶ、ＳＯＦ、ＳＯＳ、ＳＴＯ、ＳＳＦ、ＳＳＹ、ＵＳＩ、ＵＷＹ及びＶＥＴ及びそれらの混合物及び／又は連晶からなるフレームワークタイプの群から選択される大細孔モレキュラーシーブを含む、請求項１から３、５及び６の何れか一項に記載の触媒物品。

【請求項１６】

ＳＣＲ触媒が、ＭＯＲ、ＯＦＦ及びＢＥＡからなるフレームワークタイプの群から選択される大細孔モレキュラーシーブを含む、請求項１から３、５、６及び１５の何れか一項に記載の触媒物品。

【請求項１７】

高多孔度基材の多孔度より低い多孔度を有する基材を含む比較物品より大きな選択性でＮＯｘをN_2へ変換する、請求項１から１６の何れか一項に記載の触媒物品。

【請求項１８】

ＮＯｘを含む排気ガスを浄化する方法であって、ＮＯｘを含む排気ガスを、請求項１から１７の何れか一項に記載の触媒物品と接触させることを含む方法。

【請求項１９】

ＮＯｘを含む排気ガスが、約１５０℃から約５５０℃の温度において請求項１から１７の何れか一項に記載の触媒物品と接触する、請求項１８に記載の方法。

【請求項２０】

ＮＯｘをN_2へと変換し、N_2選択性が、高多孔度基材の多孔度より低い多孔度を有する基材を含む比較物品に由来するN_2選択性より大きい、請求項１８又は１９に記載の方法。